PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-221751

(43) Date of publication of application: 09.08.2002

(51)Int.CI.

G02B 5/10 G02B 26/08 G03B 15/00 G03B 17/02 HO4N 5/225

(21)Application number: 2001-016133

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

24.01.2001

(72)Inventor: MUSASHI TAKESHI

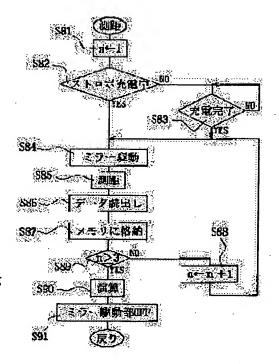
NAKANE TAKESHI

(54) CAMERA USING VARIABLE SHAPE MIRROR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a camera using a variable shape mirror which can reduce a burden of a power supply system and stabilize an operation of the variable shape mirror.

SOLUTION: The camera comprises: an imaging means for obtaining an image signal from an image picked up through an imaging lens; an exposure controlling means for implementing controls including a driving control of the imaging means by an exposing operation based on imaging conditions; the variable shape mirror having a reflecting surface deformed by electric power and an electrode for controlling a shape of the reflecting surface; a power supplying means for supplying power for driving the variable shape mirror; a driving means for driving the variable shape mirror, and a means for driving the imaging lens. When the imaging lens is driven or controlled to expose by the exposure controlling means, the variable shape mirror is not driven by the driving means.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-221751 (P2002-221751A)

(43)公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

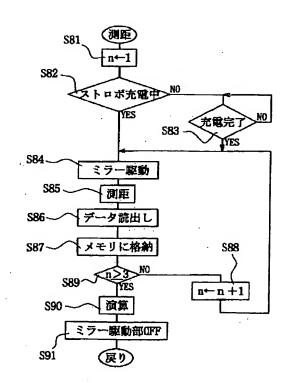
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)		
G03B	17/17		G 0 3 B	17/17			2 H O	4 1
G02B	5/10		G 0 2 B	5/10		E	3 2HO	4 2
•	26/08			26/08		F	E 2H1	0 0
G03B	15/00		G 0 3 B	15/00		F	2 H 1	0 1
	17/02			17/02			5 C 0	2 2
		審査請求	未請求 請求	マダス ないない でんぱん でんしょう はいま でんしょう はいしょう でんしょう はいしょう はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいま	OL	(全 26 頁	到 最終]	質に続く
(21)出願番号		特願2001-16133(P2001-16133)	(71)出願	ل 000000	376	·		
	•		•	オリン	バス光	学工業株式	会社	
(22)出廣日		平成13年1月24日(2001.1.24)	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号					,
			(72)発明	首 八道	M			
				東京都	渋谷区	暦ヶ谷2丁	目43番2号	オリ
			1	ンパス	光学工	業株式会社	:内	
		•	(72)発明者	育 中根	鮾			
				東京都	渋谷区	層ヶ谷2丁	目43番2号	オリ
		•		ンパス	光学工	桑株式会社	内 .	
			(74)代理)	L 1000658	8 2 4			
				弁理士	篠原	泰司 ((外1名)	
							最終〕	【に続く

(54) 【発明の名称】 可変形状鏡を用いたカメラ

(57)【要約】

【課題】電源系への負担を軽減して可変形状鏡の動作を 安定化させることが可能な可変形状鏡を用いたカメラを 提供する。

【解決手段】撮影レンズを通して結像された画像から画像信号を得る撮像手段と、撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動制御を含む制御を行う露光制御手段と、電気的な力により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡と、前記可変形状鏡を駆動するための電源を供給する電源供給手段と、前記可変形状鏡を駆動する駆動手段と、前記撮影レンズを駆動する手段と、を有し、前記撮影レンズが駆動されているか、または前記露光制御手段による露光制御が行われているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないように構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮影レンズを通して結像された画像から 画像信号を得る撮像手段と、

撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動 制御を含む制御を行う露光制御手段と、

電気的な力により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡と、

前記可変形状鏡を駆動するための電源を供給する電源供給手段と、

前記可変形状鏡を駆動する駆動手段と、

前記撮影レンズを駆動する手段と、を有し、

前記撮影レンズが駆動されているか、または前記露光制 御手段による露光制御が行われているときには、前記駆 動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにし たことを特徴とする可変形状鏡を用いたカメラ。

【請求項2】 被写体を照明するストロボの充放電を制 御するストロボ制御手段を更に有し、

前記ストロボが充放電制御されているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする請求項1に記載の可変形状鏡を用い 20たカメラ。

【請求項3】 前記撮像手段で得られた画像信号に係る データを記録する記録手段を更に有し、

前記記録手段でデータ記録をしているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする請求項1に記載の可変形状鏡を用いたカメラ。

【請求項4】 撮影モードを含む複数のモードを設定するモード設定手段を更に有し、

前記モード設定手段で撮影モード以外のモードが設定されているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする請求項1 に記載の可変形状鏡を用いたカメラ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、可変形状鏡を用いたカメラに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体プロセスを用いて、例えば 静電気等の電気的な力で鏡の反射面を変形させて所望の 40 光学特性を得ることのできる、小型の機器に適用可能な 可変形状鏡が提案されている。この可変形状鏡を用いれ ば、省スペース化による小型化や簡単な構成で高速応答 できる可変形状鏡の特徴を生かした機器が提供できる可 能性がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、可変形状鏡の 駆動制御には高電圧を要するため、電池で駆動するカメ ラ等の機器を構成する、例えば、AF(オートフォーカ ス)構成部材などの光学部材に可変形状鏡を用いた場 合、電力消費が無視できない程大きくなる。とのため、 例えば、レンズ駆動や露光制御等での電力の消費が大き な動作を行なっているときに、同時に可変形状鏡の駆動 が行われると、全体の電源負荷が大きくなりすぎ、最悪 の場合には、可変形状鏡の動作保証ができなくなるとい う問題点があった。

【0004】そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、電源系への負担を軽減して可変形状鏡の動作を安定化させることが可能な可変形状鏡を用いたカメラを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明による可変形状鏡を用いたカメラは、撮影レンズを通して結像された画像から画像信号を得る撮像手段と、撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動制御を含む制御を行う露光制御手段と、電気的な力により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡と、前記可変形状鏡を駆動するための電源を供給する電源供給手段と、前記可変形状鏡を駆動するをある電源性給手段と、前記可変形状鏡を駆動するを動きれているか、または前記露光制御手段による露光制御が行われているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする。

【0006】また、本発明による可変形状鏡を用いたカメラは、好ましくは、被写体を照明するストロボの充放電を制御するストロボ制御手段を更に有し、前記ストロボが充放電制御されているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特30 徴とする。

【0007】また、本発明による可変形状鏡を用いたカメラは、好ましくは、前記撮像手段で得られた画像信号に係るデータを記録する記録手段を更に有し、前記記録手段でデータ記録をしているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする。

【0008】また、本発明による可変形状鏡を用いたカメラは、好ましくは、撮影モードを含む複数のモードを設定するモード設定手段を更に有し、前記モード設定手段で撮影モード以外のモードが設定されているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。図1は本発明の一実施形態にかかる可変形状鏡を用いたカメラのシステム概略構成図である。本発明の可変形状鏡を備えたカメラは、未図示の絞り及びメカシャッタを有する撮影レンズ系1と、該撮影レンズ1の焦点位置を調整するためのモータとモータド50 ライバーとを備えたレンズ駆動部2と、CCDイメージ

センサ等の撮像素子3と、撮像素子3を駆動して画像信号を得る撮像回路4と、アナログ画像信号をデジタル画像信号に変換するA/D変換器6と、画像信号を一時的に蓄えておくためのバッファメモリ7と、ストロボ発光回路8と、画像処理を行なうためのDSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)20と、RISCーマイクロブロセッサ19と、データ圧縮伸長回路15と、カードスロットに装着された着脱式メモリカードとアクセスするためのI/F(インターフェース)16と、デジタル画像信号を画像表示したりビデオ出力端子からビデオ信号 10を出力するための画像データを記憶するビデオメモリ18と、外部入出力端子を介して外部機器とデータ入出力を行なうためのI/F17などを備えている。

【0010】更に、前記カメラは、撮影時に撮像素子3の露出量を求めるためのAE部5と、ストロボ発光回路8と、動作モード等の撮影情報を表示するためのモードLCD9と、撮影、再生等に係る各種動作を行なうための操作部10と、可変形状鏡ユニット11と、カメラ各部及び可変形状鏡11に対して電源供給を行なうための電源回路12を備えている。そして、前記カメラの撮影、再生等の動作に伴う各部の制御を行なうためのシステムコントローラ13を備えている。操作部10には、撮影の開始及び記録を指示する未図示のレリーズ釦、モード設定操作部等が設けられている。

【0011】図2は本実施形態のカメラに用いる可変形状鏡11を構成する電極の配置関係及び電圧制御を行なう回路部のブロック図である。可変形状鏡11は、反射面23と上部電極21とを備えた可撓性薄膜と、それに対向して配置された制御電極である下部電極22とその制御回路からなる制御基板を備え、この制御基板と図1に示す電源回路12及びシステムコントローラ13とが接続されている。

【0012】図2において、高圧電源Vpは100V程 度の定電圧源であり、リファレンス電圧Vrefは5V 程度の可変電圧である。また、駆動電圧VDは電圧制御 回路部24を駆動させるための電圧源である。これら高 電圧源Vp、リファレンス電圧Vref、駆動電圧VD は印加され電圧制御回路部24へ供給される。電圧制御 回路部24には、髙耐圧の電圧制御トランジスタ25と 制御回路26が形成されており、この電圧制御回路部2 4により低電圧であるリファレンス電圧Vrefに対応 した出力電圧になるように高電圧Vpを電圧制御し制御 電極である下部電極22へ印加する。また、クロック入 力端子CKがリファレンス電圧Vrefの変化と同期し たパルス電圧であるタイミングパルスを発するようにな っている。また、電圧制御回路部24には、上述の高耐 圧の電圧制御トランジスタ25と制御回路26の他にタ イミング発生回路27と髙耐圧のスイッチング用トラン ジスタ28が形成されている。

【0013】とのように構成された可変形状鏡(電圧制 50 でもよい。

御回路部を含む)において、分割した制御電極である下 部電極22のうちの任意の電極に印加する電圧に応じた リファレンス電圧Vrefを入力し、電圧制御トランジ スタ25と制御回路26により出力電圧を制御する。と れと同期してタイミングパルスを入力し、タイミング発 生回路27の出力により該当制御電極に対応するスイッ チング用トランジスタ28をON状態にする。一定時間 を経過してから該当スイッチング用トランジスタ28を OFF状態にし、電圧制御トランジスタ25の出力と制 御電極の接続を断ち、制御電極へ印加した電圧を一定に 保つ。これにより該当制御電極に電圧制御された電圧が 印加される。とのリファレンス電圧による電圧制御とタ イミングパルスによるスイッチング用トランジスタ28 のON-OFFを時系列に行うことで分割した全ての制 御電極に任意の電圧を印加することができる。なお、こ の場合の電圧制御回路の各部のタイミングチャートを図 3に示す。図3においては、分割した電極のうちの任意 の2つの電極について示してある。

【0014】ととで、可変形状鏡では負荷成分が対向電 20 極によるキャパシタンス成分であり、また対向電極に印 加する電圧は直流電圧であるため、分割した制御電極の 印加電圧を時系列に制御しても、各々の電極に印加され る電圧を一定に保つことは容易にできる。これら電圧制 御回路を一体化することで、外部から電源と制御信号を 供給するだけで複数に分割した制御電極を有する可変形 状鏡を駆動するととができ、また、制御電極の分割数を 増加してもそれに応じて制御回路を増やす必要は無く、 タイミング発生回路の簡単な変更とスイッチング用トラ ンジスタの増設で電圧制御をすることができるため、省 スペース化することができ、小型化に適した可変形状鏡 を提供することができる。なお、図2においては、上部 電極21を1枚で構成し下部電極22を複数枚で構成し たが、これとは逆に、上部電極21を複数の電極に分割 しこれに図2に示すような回路を接続し、下部電極22 を1枚の電極で構成し、下部電極22が反射面21を備 えるようにしてもよい。

【0015】図4は本実施形態のカメラに用いる可変形状鏡の電極部を示す説明図であり、(a)~(e)は、図2に示す上部電極21の変形状態を示す側面図、(f)及び(g)は図2に示す下部電極22の配置構成を示す平面図である。可変形状鏡の複数の下部電極22は、図4(f)に示すように、変形形状に応じて碁盤目状に分割されて構成してもよく、または、図4(g)に示すように、同心円状に分割されて構成してもよい。また、上部電極21は、図4(a)に示すように、全体が対向電極側に平行に引っ張られるように駆動させてもよく、または、図4(b)、(c)に示すように、対向電極に対し、凹状または凸状に変形させてよりに、対向電極に対し、凹状または凸状に変形させてよりに、対向電極に対し、凹状または凸状に変形させてよりに、

(4)

【0016】図5は本実施形態のカメラにおいて、可変 形状鏡を測距部に用いた例を示す説明図である。測距部 は、三角測距の原理により、所定の基線長だけ離れたレ ンズを透過した光を内蔵したセンサーで検出するととに より被写体までの距離に相応する信号を検出することが できるように構成されている。より具体的に説明する と、赤外(1R)発光ダイオード31からの赤外光を可 変形状鏡11の反射面32で反射させて、投光レンズ3 3、投光用窓34を経て被写体(図において、矢印a, b, cの延長線上にあるため図示を省略してある) に照 10 射し、被写体で反射され、受光窓35、受光レンズ36 を経た光(矢印a', b', c'で示す)をPSDなど の受光器37で受光し、その出力により被写体までの距 離を検出するように構成されている。このとき可変形状 鏡11の下部電極22を制御して反射面32をa.b. cの各方向へ投光されるように駆動する。なお、図5に おいては、測定対象となる被写体を紙面において行方向 に走査した状態を示しているが、列方向に走査させると とも勿論可能である。従って、可変形状鏡を用いること で、撮影画面上で測定対象を走査してそれぞれの箇所で 20 の焦点距離を測定することができる。

【0017】 このような可変形状鏡を駆動させる場合、 上述のように高電圧を要するため、他の電力消費の大き い動作と重なると、電源への負担が大きく駆動制御の動 作が不安定となるおそれがある。このため、カメラのそ の他の電力消費の大きい動作と重ならないように、本実 施形態にかかる可変形状鏡を用いたカメラでは、駆動の タイミングがコントロールされている。図6は本実施形 態の可変形状鏡を用いたカメラにおける撮影時の駆動制 御を示すフローチャートである。図6において、まず、 カメラのEEPROM14に記憶されていた諸データを 読み出す(ステップS1)。次いで、モード選択画面が 例えば図1に示すカメラのモードLCD9に表示され、 撮影者はモード選択を行う。そこで、撮影者により選択 されたモードをチェックする (ステップS2)。 撮影モ ードが選択されない場合には、図1に示す電源回路12 からの電源のうち駆動電源などの可変形状鏡の駆動部の 電源をOFFにして図2に示す電圧制御回路部24に電 源が供給されないようにし (ステップS3)、その後に 選択された各種モードの処理を行う(ステップS4)。 なお、モード選択には、撮影モード、撮影画像の再生モ ード、各種数値の設定モード、及び外部との通信モード 等があるが、ことでは説明の便宜上、撮影モードを選択 した場合について説明する。

【0018】撮影モードが選択された場合には、可変形状鏡の駆動部の電源をONにし、可変形状鏡を構成する図2に示す各電極22に対しEEPROM14から予め読み出しておいた所定の電圧値でもって、反射面23の向き及び変形状態を初期状態にし、その後電源をOFFにする(ステップS5)。その後、ストロボ充電処理を50

開始する(ステップS6)。次いで、レリーズ釦が半押しされているか否かのチェックを行い、レリーズ釦が半押しされるまでこの処理を繰りかえす(ステップS7)。レリーズ釦が半押しされている場合には、測距処理を行う(ステップS8)。

【0019】図7は本実施形態の可変形状鏡を用いたカ メラにおける測距処理のフローチャートである。測距処 理では、初期処理として測定位置カウンタnに1をセッ トする(ステップS81)。次に、ストロボが充電中で あるか否かのチェックを行い(ステップS82)、充電 中の場合は充電が完了するまで待つ (ステップS8 3)。ストロボの充電が完了、またはストロボ充電励作 をしていない場合には、可変形状鏡の駆動部の電源を○ Nして、電圧制御回路部24に電源を供給し、測定位置 カウンタnに対応する位置(例えば、図5のa, b, c のいずれかの位置)の距離が計測できるように反射面2 3の形状を変化させるように各電極22を駆動し、(ス テップS84)、該当位置での測定対象となる被写体の 測距を行う(ステップS85)。そして図5に示す受光 器37の出力信号に基づく測定値を読み出して(ステッ プS86)、図1に示すバッファメモリ7に一時的に格 納する(ステップS87)。

【0020】その後、測定位置カウンタnに1をプラスし(ステップS88)、測定対象となる被写体についての撮影画面内の全領域の測距が終了するまで(図においてはnが3に達するまで)、該当位置の測距を行い、その測定値をバッファメモリ7に格納するまでの処理を繰り返す(ステップS89)。なお、撮影画面内の領域の走査は、行及び列の2次元で行なってもよい。また、

a, b, cの各位置のうち、aの位置は初期状態の位置 としてもよく、この場合は残りのb, cの位置に対する 変位を行なえばよいので、位置の設定回数を減らすこと もできる。

【0021】次に、得られた各測距値より図1に示す撮影レンズ系1を介して所望位置の被写体が撮像素子に結像するように駆動すべき撮像レンズ系1を構成する所定のレンズの駆動量を算出し(ステップS90)、その後、可変形状鏡11の駆動部の電源をOFFにする(ステップS91)。これにより測距処理(ステップS8)が終了する。

【0022】なお、上記ストロボ充電チェックに際し、ストロボ充電中の場合は、ストロボ充電を一時停止させて、可変形状鏡の駆動以降の処理を優先し、反射面23の形状を変化させた後、該当位置の測距を行い、その測定値をバッファメモリに格納する処理を行い、得られた測定値より撮像レンズ系1を構成する所定のレンズの駆動量を算出し(ステップS84~ステップS89)、可変形状鏡の駆動部の電源をOFFにした(ステップS91)後にストロボ充電を再開するようにしてもよい。

| 【0023】測距処理(ステップS8)を終了後、図6

(5)

に示すように、測光処理(ステップS9)を行う。その 後、ストロボ撮影の場合にはストロボが充電中であるか 否かのチェックを行い(ステップS10)、充電中の場 合は充電が完了するまで待つ(ステップS11)。スト ロボ充電が完了しているとき、又は完了したときは、レ リーズ釦が全押しされるまで処理を待つ (ステップS1 2)。また、その間に、測距処理で得られた演算値よ り、所望の位置の被写体が撮影レンズ系1を介して撮像 素子3に結像するように、図1に示すレンズ駆動部2が 撮影レンズ系1を駆動させる。なお、レンズ駆動部2 は、上記駆動のほかに、撮影レンズ系1を変倍駆動、さ らには、沈胴、沈胴位置から撮影位置への撮像レンズ系 1を構成するレンズの駆動も行なう。

【0024】レリーズ釦が全押しされた場合には、露光 処理を行う(ステップS13)。露光処理では、測光処 理で得られた値に応じて決定した絞りの開口及びシャッ タースピードに基づいて、メカシャッタ駆動、撮像素子 3の制御、ストロボ発光等の露光動作を行ない、得られ た画像信号に基づいて画像処理を行なう(ステップS1 4)。その後、撮像された画像を画像表示し(ステップ 20 【0028】そして、図8、9の例のように、可変形状 S15)、必要に応じて撮影者の操作によりメモリカー ド等の記録媒体に記録する (ステップS16)。 との 間、可変形状鏡11の駆動部の電源は、OFF状態を保 持している。そして、画像情報の記録が終了した (ステ ップS17)後に、可変形状鏡11の駆動部の電源を0 Nして可変形状鏡11を構成する電極により反射面の向 きや変形状態を初期化し (ステップS18)、その後、 可変形状鏡11の駆動部の電源をOFFにして一駒の撮 影処理が終了する。

【0025】このように、本実施形態の可変形状鏡を用 いたカメラによれば、レンズ駆動中及び露光動作中に、 可変形状鏡への電源供給及び可変形状鏡の駆動を行わな いため、電源系への負担が小さく安定した動作を行なう ことができる。また、ストロボ充電中に可変形状鏡への 電源供給可変形状鏡の駆動を行わないため、ストロボ使 用するときでも電源系への負担が小さくて済む。さら に、撮像データ記録中に、可変形状鏡への電源供給可変 形状鏡の駆動を行わないため、データ記録動作に悪影響 を与えることがない。さらにまた、撮影モード以外の処 理において、可変形状鏡への電源供給可変形状鏡の駆動 40 を行わないため、その分省電できる。

【0026】なお、本発明の可変形状鏡を用いたカメラ は、図5の実施形態のように可変形状鏡を測距部に設け る構成以外に、可変形状鏡を撮像部に用いた構成にも適 用可能である。図8、9は本実施形態のカメラにおい て、可変形状鏡を撮像部に用いた例を示す概略構成図で ある。

【0027】図8の例では、撮像素子の前に配置する撮 像レンズ系1が、レンズ41と、可変形状鏡42と、レ

フィルター45とで構成されている。そして、可変形状 鏡42の反射面の形状を測距部を介して得られた被写体 までの距離に応じた電圧を可変形状鏡42に備えられた 電極に印加して凹状に変形させることで、反射面のパワ ーを変えて撮像系の焦点距離を変化させて、オートフォ ーカスを行うことができる。また、図9の例では、撮像 素子の前に配置する撮像レンズ系1が、レンズ51と、 傾き可変な可変形状鏡52と、レンズ群53と、赤外カ ットフィルター54と、ローパスフィルター55とで構 成されている。そして、図9の例では、傾き可変な可変 10 形状鏡52の反射面を、ヨー方向、ピッチ方向の角速度 を夫々検出する2つの角速度センサを介して得られた手 ブレ量に応じて電圧を傾き可変な可変形状鏡52に備え られた電極に印加して、傾けることによって手ブレ量を 補正することもできる。このように構成すれば、撮像レ ンズ系1を構成するレンズ群43,53を移動させると となく所望の焦点位置に調整することができ、その分レ ンズ駆動部材等を省くことができ撮影レンズ構成を簡単 にすることができる。

鏡を撮像部に用いる場合も、可変形状鏡の駆動電源部の 制御は測距部に用いた場合とほぼ同様に、メカシャッタ 駆動や、CCD蓄積読み出しや、ストロボ発光等の露光 動作及び露光処理後撮像された画像の画像表示及びメモ リカード等への記録中においては、撮像部に用いた可変 形状鏡の駆動を行なわないようにシーケンス制御すれば よい。さらに、図8の例の場合は、測距処理中において も、撮像部に用いた可変形状鏡の駆動を行なわないよう にシーケンス制御すればよい。

【0029】なお、本発明に用いる可変形状鏡は、静電 引力で駆動する構成の他に、例えば、電磁気力で駆動す る構成や、圧電効果を用いて構成したものなど、電気的 な力を用いて反射面を駆動させることができるものを用 いても勿論よい。

【0030】また、本発明におけるシーケンス制御は、 撮像系の一部を構成するレンズに可変焦点レンズを設 け、電気的な力により変形してレンズ系の焦点位置を変 えるように構成された可変焦点レンズを用いたカメラの シーケンス制御にも適用できる。

【0031】次に、本発明のカメラに適用可能な可変形 状鏡、可変焦点レンズの構成例について説明する。

【0032】まず、本発明のカメラに適用可能な可変形 状鏡について説明する。図10は本発明のカメラの他の 実施例にかかる、光学特性ミラーを用いたデジタルカメ ラのケブラー式ファインダーの概略構成図である。もち ろん、銀塩フィルムカメラにも使える。まず、光学特性・ 可変形状鏡409について説明する。

【0033】光学特性可変形状鏡409は、アルミコー ティングされた薄膜(反射面)409aと複数の電極4 ンズ群43と、赤外カットフィルター44と、ローパス 50 09bからなる光学特性可変形状鏡(以下、単に可変形 (6)

状鏡と言う。)であり、411は各電極409bにそれぞれ接続された複数の可変抵抗器、412は可変抵抗器411と電源スイッチ413を介して薄膜409aと電極409b間に接続された電源、414は複数の可変抵抗器411の抵抗値を制御するための演算装置、415、416及び417はそれぞれ演算装置414に接続された温度センサー、湿度センサー及び距離センサーで、これらは図示のように配設されて1つの光学装置を構成している。

【0034】なお、対物レンズ902、接眼レンズ90 10 1、及び、プリズム404、二等辺直角プリズム40 5、ミラー406及び可変形状鏡の各面は、平面でなく てもよく、球面、回転対称非球面の他、光軸に対して偏 心した球面、平面、回転対称非球面、あるいは、対称面 を有する非球面、対称面を1つだけ有する非球面、対称 面のない非球面、自由曲面、微分不可能な点又は線を有 する面等、いかなる形状をしていてもよく、さらに、反 射面でも屈折面でも光に何らかの影響を与え得る面なら ばよい。以下、これらの面を総称して拡張曲面という。 【0035】また、薄膜409aは、例えば、P.Rai-ch 20 oudhury編、Handbook of Michrolithography, Michroma chining and Michrofabrication, Volume 2: Michromach ining and Michrofabrication, P495, Fig. 8.58, SPIE PR ESS刊やOptics Communication, 140巻(1997年)P187~ 190亿記載されているメンブレインミラーのように、複 数の電極409bとの間に電圧が印加されると、静電気 力により薄膜409aが変形してその面形状が変化する ようになっており、これにより、観察者の視度に合わせ たピント調整ができるだけでなく、さらに、レンズ90 1,902及び/又はプリズム404、二等辺直角プリ ズム405、ミラー406の温度や湿度変化による変形 や屈折率の変化、あるいは、レンズ枠の伸縮や変形及び 光学素子、枠等の部品の組立誤差による結像性能の低下 が抑制され、常に適正にピント調整並びにピント調整で 生じた収差の補正が行われ得る。なお、電極409bの 形は、例えば図12、13に示すように、薄膜409a の変形のさせ方に応じて選べばよい。

【0036】本実施例によれば、物体からの光は、対物レンズ902及びプリズム404の各入射面と射出面で屈折され、可変形状鏡409で反射され、プリズム404を透過して、二等辺直角プリズム405でさらに反射され(図10中、光路中の+印は、紙面の裏側へ向かって光線が進むことを示している。)、ミラー406で反射され、接眼レンズ901を介して眼に入射するようになっている。とのように、レンズ901、902、プリズム404、405、及び、可変形状鏡409によって、本実施例のカメラの観察光学系を構成しており、とれらの各光学素子の面形状と肉厚を最適化することにより、物体面の収差を最小にすることができるようになっている。

【0037】すなわち、反射面としての薄膜409aの 形状は、結像性能が最適になるように演算装置414か らの信号により各可変抵抗器411の抵抗値を変化させ ることにより制御される。すなわち、演算装置414 へ、温度センサー415、湿度センサー416及び距離 サンサー417から周囲温度及び湿度並びに物体までの 距離に応じた大きさの信号が入力され、演算装置414 は、これらの入力信号に基づき周囲の温度及び湿度条件 と物体までの距離による結像性能の低下を補償すべく、 薄膜409aの形状が決定されるような電圧を電極40 9 b に印加するように、可変抵抗器411の抵抗値を決 定するための信号を出力する。 このように、 薄膜409 aは電極409bに印加される電圧すなわち静電気力で 変形させられるため、その形状は状況により非球面を含 む様々な形状をとり、印加される電圧の極性を変えれば 凸面とすることもできる。なお、距離センサー417は なくてもよく、その場合、固体撮像素子408からの像 の信号の髙周波成分が略最大になるように、デジタルカ メラの撮像レンズ403を動かし、その位置から逆に物 体距離を算出し、可変形状鏡を変形させて観察者の眼に ピントが合うようにすればよい。

【0038】また、薄膜409aをポリイミド等の合成 樹脂で製作すれば、低電圧でも大きな変形が可能である ので好都合である。なお、プリズム404と可変形状鏡 409を一体的に形成してユニット化することができる。

【0039】また、図示を省略したが、可変形状鏡40 9の基板上に固体撮像素子408をリソグラフィープロセスにより一体的に形成してもよい。

【0040】また、レンズ901,902、プリズム404,405、ミラー406は、プラスチックモールド等で形成することにより任意の所望形状の曲面を用意に形成することができ、製作も簡単である。なお、本実施例の撮像装置では、レンズ901、902がプリズム404から離れて形成されているが、レンズ901,902を設けることなく収差を除去することができるようにプリズム404,405、ミラー406、可変形状鏡409を設計すれば、プリズム404,405、可変形状鏡409は1つの光学ブロックとなり、組立が容易となる。また、レンズ901、902、プリズム404,405、ミラー406の一部あるいは全部をガラスで作製してもよく、このように構成すれば、さらに精度の良い撮像装置が得られる。

【0041】なお、図10の例では、演算装置414、温度センサー415、湿度センサー416、距離センサー417を設け、温湿度変化、物体距離の変化等も可変形状鏡409で補償するようにしたが、そうではなくてもよい。つまり、演算装置414、温度センサー415、湿度センサー416、距離センサー417を省き、観察者の視度変化のみを可変形状鏡409で補正するよ

(7)

うにしてもよい。

【0042】次に、可変形状鏡409の別の構成について述べる。

【0043】図11は本発明のカメラに適用可能な可変 形状鏡409の他の実施例を示しており、この実施例で は、薄膜409aと電極409bとの間に圧電素子40 9 c が介装されていて、これらが支持台423上に設け られている。そして、圧電素子409cに加わる電圧を 各電極409b毎に変えることにより、圧電素子409 cに部分的に異なる伸縮を生じさせて、薄膜409aの 10 形状を変えることができるようになっている。電極40 9 b の形は、図12 に示すように、同心分割であっても よいし、図13に示すように、矩形分割であってもよ く、その他、適宜の形のものを選択することができる。 図11中、424は演算装置414に接続された振れ (ブレ) センサーであって、例えばデジタルカメラの振 れを検知し、振れによる像の乱れを補償するように薄膜 409aを変形させるべく、演算装置414及び可変抵 抗器411を介して電極409bに印加される電圧を変 化させる。このとき、温度センサー415、湿度センサ -416及び距離センサー417からの信号も同時に考 慮され、ピント合わせ、温湿度補償等が行われる。との 場合、薄膜409aには圧電素子409cの変形に伴う 応力が加わるので、薄膜409aの厚さはある程度厚め に作られて相応の強度を持たせるようにするのがよい。 【0044】図14は本発明のカメラに適用可能な可変 形状鏡409のさらに他の実施例を示している。この実 施例は、薄膜409aと電極409bの間に介置される 圧電素子が逆方向の圧電特性を持つ材料で作られた2枚 の圧電素子409c及び409c'で構成されている点 30 で、図11に示された実施例とは異なる。 すなわち、圧 電素子409cと409c が強誘電性結晶で作られて いるとすれば、結晶軸の向きが互いに逆になるように配 置される。この場合、圧電素子409cと409c'は 電圧が印加されると逆方向に伸縮するので、薄膜409 aを変形させる力が図19に示した実施例の場合よりも 強くなり、結果的にミラー表面の形を大きく変えること ができるという利点がある。

【0045】圧電素子409c、409c、に用いる材料としては、例えばチタン酸バリウム、ロッシエル塩、水晶、電気石、リン酸二水素カリウム(KDP)、リン酸二水素アンモニウム(ADP)、ニオブ酸リチウム等の圧電物質、同物質の多結晶体、同物質の結晶、PbZrO,とPbTiO,の固溶体の圧電セラミックス、ニフッ化ポリビニール(PVDF)等の有機圧電物質、上記以外の強誘電体等があり、特に有機圧電物質はヤング率が小さく、低電圧でも大きな変形が可能であるので、好ましい。なお、とれらの圧電素子を利用する場合、厚さを不均一にすれば、上記実施例において薄膜409aの形状を適切に変形させることも可能である。

【0046】また、圧電素子409c, 409c'の材質としては、ポリウレタン、シリコンゴム、アクリルエラストマー、PZT、PLZT、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)等の髙分子圧電体、シアン化ビニリデン共重合体、ピニリデンフルオライドとトリフルオロエチレンの共重合体等が用いられる。圧電性を有する有機材料や、圧電性を有する合成樹脂、圧電性を有するエラストマー等を用いると可変形状鏡面の大きな変形が実現できてよい。

【0047】なお、図11、15の圧電素子409cに電金材料、例えば、アクリルエラストマー、シリコンゴム等を用いる場合には、圧電素子409cを別の基板409c-1と電金材料409c-2を貼り合わせた構造にしてもよい。

【0048】図15は本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡409のさらに他の実施例を示している。この実施例では、圧電素子409cが薄膜409aと電極409d間に演算装置414により制御される駆動回路425を介して電圧が印加されるようになっており、さらにこれとは別に、支持台423上に設けられた電極409bにも演算装置414により制御される駆動回路425を介して電圧が印加されるように構成されている。したがって、この実施例では、薄膜409aは電極409dとの間に印加される電圧と電極409bに印加される電圧による静電気力とにより二重に変形され得、上記実施例に示した何れのものよりもより多くの変形パターンが可能であり、かつ、応答性も速いという利点がある。

【0049】そして、薄膜409a、電極409d間の電圧の符号を変えれば、可変形状鏡を凸面にも凹面にも変形させることができる。その場合、大きな変形を圧電効果で行ない、微細な形状変化を静電気力で行なってもよい。また、凸面の変形には圧電効果を主に用い、凹面の変形には静電気力を主に用いてもよい。なお、電極409dは電極409bのように複数の電極から構成されてもよい。この様子を図15に示した。なお、本願では、圧電効果と電歪効果、電歪をすべてまとめて圧電効果と述べている。従って、電歪材料も圧電材料に含むものとする。

【0050】図16は本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡409のさらに他の実施例を示している。この実施例は、電磁気力を利用して反射面の形状を変化させ得るようにしたもので、支持台423の内部底面上には永久磁石426が、頂面上には窒化シリコン又はポリイミド等からなる基板409eの周縁部が載置固定されており、基板409eの表面にはアルミニウム等の金属コートで作られた薄膜409aが付設されていて、可変形状鏡409を構成している。基板409eの下面には複数のコイル427が配設されており、これらのコイル427はそれぞれ駆動回路428を介して演算装置414に

(8)

接続されている。したがって、各センサー415,416,417,424からの信号によって演算装置414において求められる光学系の変化に対応した演算装置414からの出力信号により、各駆動回路428から各コイル427にそれぞれ適当な電流が供給されると、永久磁石426との間に働く電磁気力で各コイル427は反発又は吸着され、基板409e及び薄膜409aを変形させる。

【0051】この場合、各コイル427はそれぞれ異なる量の電流を流すようにすることもできる。また、コイ 10ル427は1個でもよいし、永久磁石426を基板409 eに付設しコイル427を支持台423の内部底面側に設けるようにしてもよい。また、コイル427はリソグラフィー等の手法で作るとよく、さらに、コイル427には強磁性体よりなる鉄心を入れるようにしてもよい。

【0052】との場合、薄膜コイル427の巻密度を、図17に示すように、場所によって変化させることにより、基板409e及び薄膜409aに所望の変形を与えるようにすることもできる。また、コイル427は1個 20でもよいし、また、これらのコイル427には強磁性体よりなる鉄心を挿入してもよい。

【0053】図18は本発明のカメラに適用可能な可変 形状鏡409のさらに他の実施例を示している。この実 施例では、基板409eは鉄等の強磁性体で作られてお り、反射膜としての薄膜409aはアルミニウム等から なっている。この場合、薄膜コイルを設けなくてもすむ から、構造が簡単で、製造コストを低減することができ る。また、電源スイッチ413を切換え兼電源開閉用ス イッチに置換すれば、コイル427に流れる電流の方向 30 を変えることができ、基板409e及び薄膜409aの 形状を自由に変えることができる。図19はこの実施例 におけるコイル427の配置を示し、図20はコイル4 27の他の配置例を示しているが、これらの配置は、図 16に示した実施例にも適用することができる。なお、 図21は、図16に示した実施例において、コイル42 7の配置を図20に示したようにした場合に適する永久 磁石426の配置を示している。すなわち、図21に示 すように、永久磁石426を放射状に配置すれば、図1 6に示した実施例に比べて、微妙な変形を基板409e 及び薄膜409aに与えることができる。また、このよ うに電磁気力を用いて基板409e及び薄膜409aを 変形させる場合(図10及び図18の実施例)は、静電 気力を用いた場合よりも低電圧で駆動できるという利点 がある。

【0054】以上いくつかの可変形状鏡の実施例を述べたが、ミラーの形を変形させるのに、図15の例に示すように、2種類以上の力を用いてもよい。つまり静電気力、電磁力、圧電効果、磁歪、流体の圧力、電場、磁場、温度変化、電磁波等のうちから2つ以上を同時に用 50

いて可変形状鏡を変形させてもよい。つまり2つ以上の 異なる駆動方法を用いて光学特性可変光学素子を作れ ば、大きな変形と微細な変形とを同時に実現でき、精度 の良い鏡面が実現できる。

【0055】図22は本発明のさらに他の実施例に係る、カメラに適用可能な可変形状鏡409を用いた撮像系、例えば携帯電話のデジタルカメラ、カプセル内視鏡、電子内視鏡、パソコン用デジタルカメラ、PDA用デジタルカメラ等に用いられる撮像系の概略構成図である。本実施例の撮像系は、可変形状鏡409と、レンズ902と、固体撮像素子408と、制御系103とで一つの撮像ユニット104を構成している。本実施例の撮像ユニット902では、レンズ102を通った物体からの光は可変形状鏡409で集光され、固体撮像素子408の上に結像する。可変形状鏡409は、光学特性可変光学素子の一種であり、可変焦点ミラーとも呼ばれている。

【0056】本実施例によれば、物体距離が変わっても可変形状鏡409を変形させるととでピント合わせをするととができ、レンズをモータ等で駆動する必要がなく、小型化、軽量化、低消費電力化の点で優れている。また、撮像ユニット104は本発明の撮像系としてすべての実施例で用いることができる。また、可変形状鏡409を複数用いることでズーム、変倍の撮像系、光学系を作ることができる。なお、図22では、制御系103にコイルを用いたトランスの昇圧回路を含む制御系の構成例を示している。特に積層型圧電トランスを用いると、小型化できてよい。昇圧回路は本発明のすべての電気を用いる可変形状鏡、可変焦点レンズに用いることができるが、特に静電気力、圧電効果を用いる場合の可変形状鏡、可変焦点レンズに有用である。

【0057】図23は本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡のさらに他の実施例に係る、マイクロボンブ180で流体161を出し入れし、レンズ面を変形させる可変形状鏡188の概略構成図である。本実施例によれば、レンズ面を大きく変形させることが可能になるというメリットがある。マイクロボンブ180は、例えば、マイクロマシンの技術で作られた小型のボンブで、電力で動くように構成されている。流体161は、透明基板163と、弾性体164との間に挟まれている。マイクロマシンの技術で作られたポンプの例としては、熱変形を利用したもの、圧電材料を用いたもの、静電気力を用いたものなどがある。

【0058】図24は本発明のカメラに適用可能なマイクロボンブの一実施例を示す概略構成図である。本実施例のマイクロボンブ180では、振動板181は静電気力、圧電効果等の電気力により振動する。図24では静電気力により振動する例を示しており、図24中、182、183は電極である。また、点線は変形した時の振動板181を示している。振動板181の振動に伴い、

(9)

2つの弁184, 185が開閉し、流体161を右から 左へ送るようになっている。

【0059】本実施例の可変形状鏡188では、反射膜 189が流体161の量に応じて凹凸に変形すること で、可変形状鏡として機能する。可変形状鏡188は流 体161で駆動されている。流体としては、シリコンオ イル、空気、水、ゼリー、等の有機物、無機物を用いる ことができる。

【0060】なお、静電気力、圧電効果を用いた可変形 状鏡、可変焦点レンズなどにおいては、駆動用に高電圧 10 が必要になる場合がある。その場合には、例えば図22 に示すように、昇圧用のトランス、あるいは圧電トラン ス等を用いて制御系を構成するとよい。また、反射用の 薄膜409aは、変形しない部分にも設けておくと、可 変形状鏡の形状を干渉計等で測定する場合に、基準面と して使うことができ便利である。

【0061】次に、本発明のカメラに適用可能な可変焦 点レンズについて説明する。図25は本発明のカメラに 適用可能な可変焦点レンズの原理的構成を示す図であ *

$2 n m \le D \le \lambda / 5$

とする。すなわち、液晶分子517の大きさは、2nm 程度以上であるので、平均の直径Dの下限値は、2nm 以上とする。また、Dの上限値は、可変焦点レンズ51 1の光軸方向における高分子分散液晶層514の厚さ t にも依存するが、λに比べて大きいと、高分子の屈折率 と液晶分子517の屈折率との差により、高分子セル5 18の境界面で光が散乱して高分子分散液晶層514が 不透明になってしまうため、後述するように、好ましく※

$$n_{ox} = n_{oy} = n_{o}$$

である。ただし、n。は常光線の屈折率を示し、n。、お よびn。、は、常光線を含む面内での互いに直交する方向 の屈折率を示す。

【0064】ととで、図25に示すように、スイッチ5 15をオフ、すなわち髙分子分散液晶層514に電界を 印加しない状態では、液晶分子517が様々な方向を向 いているので、入射光に対する高分子分散液晶層514 の屈折率は高く、屈折力の強いレンズとなる。これに対 し、図27に示すように、スイッチ515をオンとして 高分子分散液晶層514に交流電界を印加すると、液晶 分子517は、屈折率楕円体の長軸方向が可変焦点レン ズ511の光軸と平行となるように配向するので、屈折 率が低くなり、屈折力の弱いレンズとなる。

$$(n_{ox} + n_{oy} + n_z) / 3 \equiv n_{ic}$$

40

となる。また、上記(2)式が成り立つときの平均屈折率 ☆ ☆ n.cは、n.を異常光線の屈折率n.と表して、

$$(2 n_0 + n_1) / 3 \equiv n_{10}$$

で与えられる。とのとき、高分子分散液晶層514の屈 折率n,は、高分子セル518を構成する高分子の屈折 率をn,とし、高分子分散液晶層514の体積に占める ◆

$$n_A = f f \cdot n_{LC}' + (1 - f f) n_F$$

で与えられる。

*る。この可変焦点レンズ511は、第1、第2の面とし てのレンズ面508a,508bを有する第1のレンズ 512aと、第3, 第4の面としてのレンズ面509 a, 509 bを有する第2のレンズ512 bと、これら レンズ間に透明電極513a,513bを介して設けた 高分子分散液晶層514とを有し、入射光を第1. 第2 のレンズ5 1 2 a, 5 1 2 b を経て収束させるものであ る。透明電極513a, 513bは、スイッチ515を 介して交流電源516に接続して、高分子分散液晶層5 14に交流電界を選択的に印加するようにする。なお、 高分子分散液晶層514は、それぞれ液晶分子517を 含む球状、多面体等の任意の形状の多数の微小な高分子 セル518を有して構成し、その体積は、高分子セル5 18を構成する髙分子および液晶分子517がそれぞれ 占める体積の和に一致させる。

【0062】ととで、高分子セル518の大きさは、例 えば球状とする場合、その平均の直径Dを、使用する光 の波長をλとするとき、例えば、

··· (1) .

※は λ / 5 以下とする。可変焦点レンズが用いられる光学 製品によっては髙精度を要求しない場合もあり、そのと きDはλ以下でよい。なお、高分子分散液晶層514の 透明度は、厚さtが厚いほど悪くなる。

【0063】また、液晶分子517は、例えば、一軸性 のネマティック液晶分子を用いる。この液晶分子517 の屈折率楕円体は、図26に示すような形状となり、

...(2)

30★【0065】なお、高分子分散液晶層514に印加する 電圧は、例えば、図28に示すように、可変抵抗器51 9により段階的あるいは連続的に変化させることもでき る。このようにすれば、印加電圧が高くなるにつれて、 液晶分子517は、その楕円長軸が徐々に可変焦点レン ズ511の光軸と平行となるように配向するので、屈折 力を段階的あるいは連続的に変えることができる。

【0066】ととで、図25に示す状態、すなわち高分 子分散液晶層514に電界を印加しない状態での、液晶 分子517の平均屈折率n、c'は、図26に示すように 屈折率楕円体の長軸方向の屈折率をn、とすると、およ そ

...(3)

... (4)

◆液晶分子517の体積の割合をffとすると、マックス ウェル・ガーネットの法則により、

... (5)

【0067】したがって、図28に示すように、レンズ

※20

512a および512bの内側の面、すなわち高分子分 散液晶層514側の面の曲率半径を、それぞれR、およ *

 $1/f_1 = (n_A - 1) (1/R_1 - 1/R_2)$

で与えられる。なお、R、およびR、は、曲率中心が像点 側にあるとき、正とする。また、レンズ512aおよび 512bの外側の面による屈折は除いている。つまり、※

$$(n_{ox} + n_{oy}) / 2 = n_{o}'$$

とすれば、図27に示す状態、すなわち高分子分散液晶 層514に電界を印加した状態での、高分子分散液晶層★

$$n_{e} = f f \cdot n_{e}' + (1 - f f) n_{e}$$

で与えられる。なお、高分子分散液晶層514に、図2 7におけるよりも低い電圧を印加する場合の焦点距離... は、(6)式で与えられる焦点距離 f,と、(9)式で与えら ◆

$$|(f_2-f_1)/f_2|=|(n_1-n_A)/(n_1-1)|$$

で与えられる。したがって、この変化率を大きくするに* *は、|n。-n、|を大きくすればよい。ここで、

$$n_B - n_A = f f (n_O' - n_{LC}')$$

であるから、 | n。' - n₁c' | を大きくすれば、変化 率を大きくすることができる。実用的には、n.が、

0.
$$0.1 \le |n_{o}' - n_{c}'| \le 10$$

とすれば、ff=0.5のとき、高分子分散液晶層51 4による焦点距離を、0.5%以上変えることができる ので、効果的な可変焦点レンズを得ることができる。な お、 | n。' - n (c' | は、液晶物質の制限から、10' を越えるととはできない。

【0070】次に、上記(1)式の上限値の根拠について 説明する。「Solar Energy Materials and Solar Cell s」31卷,Wilson and Eck,1993, Eleevier Science Publ iation using scattering/transparent switching film 5 」には、高分子分散液晶の大きさを変化させたときの 透過率での変化が示されている。そして、かかる文献の 第206 頁、図6には、高分子分散液晶の半径をrとし、 $t = 300 \mu m$, f f = 0.5, $n_r = 1.45$, $n_{1s} \star$

$$D \cdot t \leq \lambda \cdot 15 \mu m$$

であれば、では70%~80%以上となり、レンズとし τ 十分実用になる。したがって、例えば、 $t = 75 \mu m$ の場合は、D≦λ/5で、十分な透過率が得られること になる。

【0073】また、高分子分散液晶層514の透過率 ☆

$$n_P = (n_o' + n_{LC}') / 2$$

を満足するときである。

【0074】ととで、可変焦点レンズ511は、レンズ として使用するものであるから、図25の状態でも、図 27の状態でも、透過率はほぼ同じで、かつ高い方が良◆

$$n_{\bullet}' \leq n_{\bullet} \leq n_{\iota c}'$$

とすればよい。

【0075】上記(14)式を満足すれば、上記(13)式は、*

 $D \cdot t \leq \lambda \cdot 60 \mu m$

*びR,とすると、可変焦点レンズ511の焦点距離f 、は、

※ 高分子分散液晶層 5 1 4 のみによるレンズの焦点距離 が、(6)式で与えられる。

【0068】また、常光線の平均屈折率を、

...(7)

★514の屈折率n_{*}は、

で与えられるので、との場合の高分子分散液晶層 5 1 4 ☆ ☆のみによるレンズの焦点距離 f , は、

【0069】上記(6)および(9)式から、高分子分散液晶 層514による焦点距離の変化率は、

$$(n_{B}-1) \mid \cdots (10)$$

※1.3~2程度であるから、

...(12)

★=1.585、λ=500nmとするとき、透過率τ は、理論値で、r=5 nm($D=\lambda/50$ 、 $D\cdot t=\lambda$ \cdot 6 μ m(ただし、Dおよび λ の単位はnm、以下も同 じ)) のときτ = 90%となり、r = 25 n m ($D = \lambda$ /10)のときで≒50%になることが示されている。 【0071】 Cとで、例えば、t=150 μmの場合を 推定してみると、透過率でがtの指数関数で変化すると 仮定して、 $t=150 \mu m$ の場合の透過率 τ を推定して ishersB.v.発行の第197~214 頁、「Transmission var 30 みると、r=25nm(D=λ/10、D・t=λ・1 $5 \mu m$) のとき $\tau = 7.1\%$ となる。また、 $t = 7.5 \mu m$ の場合は、同様に、r=25nm (D=λ/10、D・ $t = \lambda \cdot 7.5 \mu m$) のとき $\tau = 80\%$ となる。 【0072】これらの結果から、

... (13)

☆は、n。の値がnuc¹の値に近いほど良くなる。一方、 n。'とn,とが異なる値になると、高分子分散液晶層 5 14の透過率は悪くなる。図25の状態と図27の状態 40 とで、平均して高分子分散液晶層514の透過率が良く なるのは、

... (14)

◆い。そのためには、髙分子セル518を構成する髙分子 の材料および液晶分子517の材料に制限があるが、実 用的には、

... (15)

*さらに緩和され、

... (16)

であれば良いことになる。なぜなら、フレネルの反射則 によれば、反射率は屈折率差の2乗に比例するので、高 分子セル518を構成する高分子と液晶分子517との 境界での光の反射、すなわち髙分子分散液晶層514の*

であればよい。ただし、(n,-n,) 'は、(n,c'-

n,) 'と(n。-n,) 'とのうち、大きい方である。 【0077】また、可変焦点レンズ511の焦点距離変※

 $0.1 \le f \le 0.999$

*透過率の減少は、およそ上記の高分子と液晶分子517 との屈折率の差の2乗に比例するからである。

【0076】以上は、n。' ≒1.45、n_s ' ≒1. 585の場合であったが、より一般的に定式化すると、

 $D \cdot t \le \lambda \cdot 15 \mu m \cdot (1.585 - 1.45)^{2} / (n_{\mu} - n_{\mu})^{2} \cdots (17)$

※化を大きくするには、ffの値が大きい方が良いが f f=1では、高分子の体積がゼロとなり、高分子セル5 18を形成できなくなるので、

とする。一方、 f f は、小さいほどでは向上するので、☆10☆上記(17)式は、好ましくは、

 $4 \times 10^{-6} (\mu \text{ m})^{2} \leq D \cdot t \leq \lambda \cdot 45 \mu \text{ m} \cdot (1.585 - 1.45)^{2} / (n_{u} - n_{e})^{2} \cdots (19)$

(11)

とする。なお、tの下限値は、図25から明らかなよう に、t=Dで、Dは、上述したように2nm以上である ので、D・tの下限値は、(2×10⁻¹μm)¹、すな わち4×10⁻⁶ (μm) ²となる。

【0078】なお、物質の光学特性を屈折率で表す近似 が成り立つのは、「岩波科学ライブラリー8 小惑星が☆

 $7 \text{ n m} \leq D \leq 500 \lambda$

とする。

11を用いるデジタルカメラ用の撮像光学系の構成を示 すものである。との撮像光学系においては、物体 (図示 せず)の像を、絞り521、可変焦点レンズ511およ びレンズ522を介して、例えばCCDよりなる固体撮 像素子523上に結像させる。なお、図37では、液晶 分子の図示を省略してある。

【0080】かかる撮像光学系によれば、可変抵抗器5 19により可変焦点レンズ511の高分子分散液晶層5 14に印加する交流電圧を調整して、可変焦点レンズ5 11の焦点距離を変えることより、可変焦点レンズ51 30 1 およびレンズ522を光軸方向に移動させることな く、例えば、無限遠から600mmまでの物体距離に対 して、連続的に合焦させることが可能となる。

【0081】図30は本発明のカメラに適用可能な可変◇

$$p \sin \theta = m \lambda$$

を満たす角度θだけ偏向されて出射される。また、溝深 さをh、透明基板33の屈折率をnjjとし、kを整数と*

$$h (n_{\lambda} - n_{33}) = m \lambda$$

$$h (n_s - n_{s,s}) = k \lambda$$

*すると、

...(22)

...(23)

を満たせば、波長λで回折効率が100%となり、フレ 40%【0083】ここで、上記(22)および(23)式の両辺の差 アの発生を防止することができる。 を求めると、

 $h(n_A - n_B) = (m - k) \lambda$

が得られる。したがって、例えば、λ=500nm、n x=1.55、na=1.5とすると、

0. $05h = (m-k) \cdot 500nm$

となり、m=1, k=0とすると、

 $h = 10000nm = 10 \mu m$

となる。との場合、透明基板533の屈折率n,,は、上 記(22)式から、n,,=1.5であればよい。また、可変 焦点回折光学素子531の周辺部における格子ピッチp 50 る。

... (24) を 10μ mとすると、 $\theta = 2.87$ となり、Fナンバ ーが10のレンズを得ることができる。

【0084】かかる、可変焦点回折光学素子531は、 高分子分散液晶層514への印加電圧のオン・オフで光 路長が変わるので、例えば、レンズ系の光束が平行でな い部分に配置して、ピント調整を行うのに用いたり、レ ンズ系全体の焦点距離等を変えるのに用いることができ

☆やってくる」向井正著,1994,岩波書店発行の第58頁に 記載されているように、Dが10nm~5nmより大き い場合である。また、Dが500入を越えると、光の散 乱は幾何学的となり、髙分子セル518を構成する髙分 子と液晶分子517との界面での光の散乱がフレネルの 反射式に従って増大するので、Dは、実用的には、

... (20)

◇焦点回折光学素子の一例の構成を示す図である。この可 【0079】図29は、図28に示す可変焦点レンズ5 20 変焦点回折光学素子531は、平行な第1, 第2の面5 32a, 532bを有する第1の透明基板532と、光 の波長オーダーの溝深さを有する断面鋸歯波状のリング 状回折格子を形成した第3の面533aおよび平坦な第 4の面533bを有する第2の透明基板533とを有 し、入射光を第1, 第2の透明基板532, 533を経 て出射させるものである。第1, 第2の透明基板53 2,533間には、図25で説明したと同様に、透明電 極513a, 513bを介して高分子分散液晶層514 を設け、透明電極513a, 513bをスイッチ515 を経て交流電源516に接続して、高分子分散液晶層5 14に交流電界を印加するようにする。

> 【0082】かかる構成において、可変焦点回折光学素 子531に入射する光線は、第3の面533aの格子ピ ッチをpとし、mを整数とすると、

【0085】なお、この実施形態において、上記(22)~* *(24)式は、実用上、

0. $7 \text{ m} \lambda \leq h (n_{\star} - n_{\star}) \leq l. 4 \text{ m} \lambda$...(25)

0. $7k\lambda \leq h(n_n-n_{11}) \leq 1.4k\lambda$... (26)

0. 7 (m-k) $\lambda \le h$ $(n_A-n_B) \le 1$. 4 (m-k) λ ... (27)

を満たせば良い。

【0086】また、ツイストネマティック液晶を用いる 可変焦点レンズもある。図31および図32は、この場 合の可変焦点眼鏡550の構成を示すものであり、可変 焦点レンズ551は、レンズ552および553と、と れらレンズの内面上にそれぞれ透明電極513a,51 3bを介して設けた配向膜539a,539bと、これ ら配向膜間に設けたツイストネマティック液晶層554 とを有して構成し、その透明電極513a, 513bを 可変抵抗器519を経て交流電源516に接続して、ツ イストネマティック液晶層554に交流電界を印加する※

21

$2 \text{ n m} \leq P \leq 2 \lambda / 3$

とする。なお、この条件の下限値は、液晶分子の大きさ で決まり、上限値は、入射光が自然光の場合に、図31 の状態でツイストネマティック液晶層554が等方媒質 として振る舞うために必要な値であり、この上限値の条 20 件を満たさないと、可変焦点レンズ551は偏光方向に よって焦点距離の異なるレンズとなり、これがため二重 像が形成されてぼけた像しか得られなくなる。

【0089】図33(a)は、本発明のカメラに適用可能 な可変偏角プリズムの構成を示すものである。との可変 偏角プリズム561は、第1, 第2の面562a, 56 2bを有する入射側の第1の透明基板562と、第3. 第4の面563a, 563bを有する出射側の平行平板 状の第2の透明基板563とを有する。入射側の透明基 板562の内面(第2の面) 562 bは、フレネル状に 30 形成し、この透明基板562と出射側の透明基板563 との間に、図25で説明したと同様に、透明電極513 a, 513bを介して高分子分散液晶層514を設け る。透明電極513a, 513bは、可変抵抗器519 を経て交流電源516に接続し、これにより高分子分散 液晶層514に交流電界を印加して、可変偏角プリズム 561を透過する光の偏角を制御するようにする。な お、図33(a)では、透明基板562の内面562bを フレネル状に形成したが、例えば、図33(b)に示すよ うに、透明基板562および563の内面を相対的に傾 40 斜させた傾斜面を有する通常のプリズム状に形成すると ともできるし、あるいは図30に示した回折格子状に形 成することもできる。回折格子状に形成する場合には、 上記の(21)~(27)式が同様にあてはまる。

【0090】かかる構成の可変偏角プリズム561は、 例えば、TVカメラ、デジタルカメラ、フィルムカメ ラ、双眼鏡等のブレ防止用として有効に用いることがで きる。との場合、可変偏角プリズム561の屈折方向 (偏向方向)は、上下方向とするのが望ましいが、さら

※ようにする。

で、例えば、

【0087】かかる構成において、ツイストネマティッ ク液晶層554に印加する電圧を高くすると、液晶分子 555は、図32に示すようにホメオトロピック配向と なり、図31に示す印加電圧が低いツイストネマティッ ク状態の場合に比べて、ツイストネマティック液晶層 5 54の屈折率は小さくなり、焦点距離が長くなる。 【0088】 ことで、図31に示すツイストネマティッ ク状態における液晶分子555の螺旋ビッチPは、光の 波長λに比べて同じ程度か十分小さくする必要があるの

··· (28)

561を偏向方向を異ならせて、例えば図34に示すよ うに、上下および左右の直交する方向で屈折角を変える ように配置するのが望ましい。なお、図33および図3 4では、液晶分子の図示を省略してある。

【0091】図35は本発明のカメラに適用可能な可変。 焦点レンズとしての可変焦点ミラーを示すものである。 この可変焦点ミラー565は、第1, 第2の面566 a, 566bを有する第1の透明基板566と、第3. 第4の面567a, 567bを有する第2の透明基板5 67とを有する。第1の透明基板566は、平板状また はレンズ状に形成して、内面 (第2の面) 566 bに透 明電極513aを設け、第2の透明基板567は、内面 (第3の面) 567aを凹面状に形成して、該凹面上に 反射膜568を施し、さらにこの反射膜568上に透明 電極513bを設ける。透明電極513a, 513b間 には、図25で説明したと同様に、高分子分散液晶層5 14を設け、これら透明電極513a, 513bをスイ ッチ515および可変抵抗器519を経て交流電源51 6に接続して、高分子分散液晶層514に交流電界を印 加するようにする。なお、図35では、液晶分子の図示 を省略してある。

【0092】かかる構成によれば、透明基板566側か ら入射する光線は、反射膜568により高分子分散液晶 層514を折り返す光路となるので、高分子分散液晶層 514の作用を2回もたせることができると共に、高分 子分散液晶層514への印加電圧を変えることにより、 反射光の焦点位置を変えることができる。この場合、可 変焦点ミラー565に入射した光線は、高分子分散液晶 層514を2回透過するので、高分子分散液晶層514 の厚さの2倍をしとすれば、上記の各式を同様に用いる ことができる。なお、透明基板566または567の内 面を、図30に示したように回折格子状にして、高分子 分散液晶層514の厚さを薄くすることもできる。この に性能を向上させるためには、2個の可変偏角プリズム 50 ようにすれば、散乱光をより少なくできる利点がある。

(13)

【0093】なお、以上の説明では、液晶の劣化を防止 するため、電源として交流電源516を用いて、液晶に 交流電界を印加するようにしたが、直流電源を用いて液 晶に直流電界を印加するようにすることもできる。ま た、液晶分子の方向を変える方法としては、電圧を変化 させること以外に、液晶にかける電場の周波数、液晶に かける磁場の強さ・周波数、あるいは液晶の温度等を変 化させることによってもよい。以上に示した実施形態に おいて、髙分子分散液晶は液状ではなく固体に近いもの もあるので、その場合はレンズ512a, 512bの一 10 方、透明基板532、レンズ538、レンズ552、5 53の一方、図33(a)における透明基板563、図3 3(b)における透明基板562,563の一方、透明基 板566、567の一方はなくてもよい。

23

【0094】図36は本発明のカメラに適用可能なさら に他の実施例に係る、可変焦点レンズ140を用いた撮 像ユニット141の概略構成図である。撮像ユニット1 41は本発明の撮像系として用いることができる。本実 施例では、レンズ102と可変焦点レンズ140とで、 撮像レンズを構成している。そして、この撮像レンズと 20 固体撮像素子408とで撮像ユニット141を構成して いる。可変焦点レンズ140は、透明部材142と圧電 性のある合成樹脂等の柔らかい透明物質143とで、光 を透過する流体あるいはゼリー状物質144を挟んで構 成されている。

【0095】流体あるいはゼリー状物質144として は、シリコンオイル、弾性ゴム、ゼリー、水等を用いる ことができる。透明物質143の両面には透明電極14 5が設けられており、回路103'を介して電圧を加え ることで、透明物質143の圧電効果により透明物質1 43が変形し、可変焦点レンズ140の焦点距離が変わ るようになっている。従って、本実施例によれば、物体 距離が変わった場合でも光学系をモーター等で動かすと となくフォーカスができ、小型、軽量、消費電力が少な い点で優れている。

【0096】なお、図36中、145は透明電極、14 6は流体をためるシリンダーである。また、透明物質1 43の材質としては、ポリウレタン、シリコンゴム、ア クリルエラストマー、PZT、PLZT、ポリフッ化ビ ニリデン(PVDF)等の髙分子圧電体、シアン化ビニ 40 リデン共重合体、ビニリデンフルオライドとトリフルオ ロエチレンの共重合体等が用いられる。圧電性を有する 有機材料や、圧電性を有する合成樹脂、圧電性を有する エラストマー等を用いると可変焦点レンズ面の大きな変 形が実現できてよい。可変焦点レンズには透明な圧電材 料を用いるとよい。

【0097】なお、図36の例で、可変焦点レンズ14 0は、シリンンダー146を設けるかわりに、図37に 示すように、支援部材147を設けてシリンダー146

透明電極145を挟んで、透明物質143の一部の周辺 部分を固定している。本実施例によれば、透明物質14 3に電圧をかけることによって、透明物質143が変形 しても、図38に示すように、可変焦点レンズ140全 体の体積が変わらないように変形するため、シリンダー 146が不要になる。なお、図37、38中、148は 変形可能な部材で、弾性体、アコーディオン状の合成樹 脂または金属等でできている。

【0098】図36、図37に示す実施例では、電圧を 逆に印加すると透明物質143は逆向きに変形するので 凹レンズにするととも可能である。なお、透明物質14 3に電歪材料、例えば、アクリルエラストマー、シリコ ンゴム等を用いる場合は、透明物質143を透明基板と 電歪材料を貼り合わせた構造にするとよい。

【0099】図39は本発明のカメラに適用可能な可変 焦点レンズのさらに他の実施例に係る、マイクロポンプ 160で流体161を出し入れし、レンズ面を変形させ る可変焦点レンズ162の概略構成図である。マイクロ ポンプ160は、例えば、マイクロマシンの技術で作ら れた小型のボンブで、電力で動くように構成されてい る。流体161は、透明基板163と、弾性体164と の間に挟まれている。図39中、165は弾性体164 を保護するための透明基板で、設けなくてもよい。マイ クロマシンの技術で作られたポンプの例としては、熱変 形を利用したもの、圧電材料を用いたもの、静電気力を 用いたものなどがある。

【0100】そして、図24で示したようなマイクロボ ンプ180を、例えば、図39に示す可変焦点レンズに 用いるマイクロポンプ160のように、2つ用いればよ 30 hi

【0101】なお、静電気力、圧電効果を用いた可変焦 点レンズなどにおいては、駆動用に高電圧が必要になる 場合がある。その場合には、昇圧用のトランス、あるい は圧電トランス等を用いて制御系を構成するとよい。特 に積層型圧電トランスを用いると小型にできてよい。

【0102】図40は本発明のカメラに適用可能な光学 特性可変光学素子の他の実施例であって圧電材料200 を用いた可変焦点レンズ201の概略構成図である。圧 電材料200には透明物質143と同様の材料が用いら れており、圧電材料200は、透明で柔らかい基板20 2の上に設けられている。なお、基板202には、合成 樹脂、有機材料を用いるのが望ましい。本実施例におい ては、2つの透明電極59を介して電圧を圧電材料20 0に加えることで圧電材料200は変形し、図40にお いて凸レンズとしての作用を持っている。

【0103】なお、基板202の形をあらかじめ凸状に 形成しておき、かつ、2つの透明電極59のうち、少な くとも一方の電極の大きさを基板202と異ならせてお く、例えば、一方の透明電極59を基板202よりも小 を省略した構造にしてもよい。支援部材147は、間に 50 さくしておくと、電圧を切ったときに、図41に示すよ

(14)

うに、2つの透明電極59が対向する所定部分だけが凹状に変形して凹レンズの作用を持つようになり、可変焦点レンズとして動作する。このとき基板202は、流体161の体積が変化しないように変形するので、液溜168が不要になるというメリットがある。

【0104】本実施例では、流体161を保持する基板の一部分を圧電材料で変形させて、液溜168を不要としたところに大きなメリットがある。なお、図39の実施例にも言えることであるが、透明基板163,165はレンズとして構成しても、或いは平面で構成してもよい。

【0105】図42は本発明のカメラに適用可能な光学特性可変光学素子のさらに他の実施例であって圧電材料からなる2枚の薄板200A、200Bを用いた可変焦点レンズの概略構成図である。本実施例の可変焦点レンズは、薄板200Aと200Bの材料の方向性を反転させることで、変形量を大きくし、大きな可変焦点範囲が得られるというメリットがある。なお、図42中、204はレンズ形状の透明基板である。本実施例においても、紙面の右側の透明電極59は基板202よりも小さ20く形成されている。

【0106】なお、図40~図42の実施例において、 基板202、薄板200、200A、200Bの厚さを 不均一にして、電圧を掛けたときの変形のさせかたをコントロールしてもよい。そのようにすれば、レンズの収 差補正等もすることができ、便利である。

【0107】図43は本発明のカメラに適用可能な可変 焦点レンズのさらに他の実施例を示す概略構成図であ る。本実施例の可変焦点レンズ207は、例えばシリコ ンゴムやアクリルエラストマー等の電歪材料206を用 30 いて構成されている。本実施例の構成によれば、電圧が 低いときには、図43に示すように、凸レンズとして作 用し、電圧を上げると、図44に示すように、電歪材料 206が上下方向に伸びて左右方向に縮むので、焦点距 離が伸びる。従って、可変焦点レンズとして動作する。 本実施例の可変焦点レンズによれば、大電源を必要とし ないので消費電力が小さくて済むというメリットがあ る。

【0108】図45は本発明のカメラに適用可能な光学特性可変光学素子のさらに他の実施例であってフォトニ 40カル効果を用いた可変焦点レンズの概略構成図である。本実施例の可変焦点レンズ214は、透明弾性体208,209でアゾベンゼン210が挟まれており、アゾベンゼン210には、透明なスペーサー211を経由して紫外光が照射されるようになっている。図45中、212,213はそれぞれ中心波長が入1、入2の例えば紫外LED、紫外半導体レーザー等の紫外光源である。【0109】本実施例において、中心波長が入1の紫外光が図46(a)に示すトランス型のアゾベンゼンに照射

されると、アゾベンゼン210は、図46(b)に示すシ

ス型に変化して体積が減少する。とのため、可変焦点レンズ214の形状はうすくなり、凸レンズ作用が減少する。一方、中心波長が入。の紫外光がシス型のアゾベンゼン210に照射されると、アゾベンゼン210はシス型からトランス型に変化して、体積が増加する。とのため、可変焦点レンズ214の形状は厚くなり、凸レンズ作用が増加する。とのようにして、本実施例の光学素子214は可変焦点レンズとして作用する。また、可変焦点レンズ214では、透明弾性体208、209の空気との境界面で紫外光が全反射するので外部に光がもれず、効率がよい。

【0110】以上述べた各実施例の可変焦点レンズにおいては、透明電極145、59、508a、509a、513a、513b等は複数に分割されていてもよい。そして、分割された透明電極のそれぞれに異なる電圧を加えることによって、光学装置のピント合わせ、ズーム、変倍のみならず、振れ補正、製造誤差による光学性能の低下の補償、収差の補正等が可能になる。

【0111】次に、本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズに用いる透明電極の分割例を図47~50を用いて説明する。図47の例は、透明電極600を同心状に分割した例を示している。周辺部にいくほど輪帯の幅が狭くなっている。これは収差を補正しやすくするためである。

【0112】図48の例は、輪帯をさらに分割したもので、電極の境界線が3つずつ一点に集まるように分けてある部分を含んでいる。とのようにすると、圧電材料200の形状が滑らかに変化するので収差の少ないレンズが得られる。

【0113】図49の例は、透明電極600を6角形に 分割したもので、上記と同様の理由により電極の境界線 が3つずつ一点で集まるように分けてある部分を含んで いる。

【0114】なお、図48、49の例においてそれぞれ分割された一つ一つの電極600A、600B、600C……は、ほぼ同じ面積にした方が収差補正上有利である。このため、分割された電極のうち最も面積の大きい電極と最も面積の小さい電極との面積比は100:1以内に抑えるのがよい。また、電極分割の配列は、図47、48、49の例のように、対称の中心の電極600Aを包むようにすると円形レンズの場合、特に収差補正上有利となる。また、一点に集まる透明電極の境界線が相互になす角が90°よりも大きくなるようにしてもよい。また、図50の例に示すように、電極の分割は格子状にしてもよい。このような分割形態にすれば、簡単に製作できるというメリットがある。

【0115】また、光学系の収差或いは振れを充分に補正するには、透明分割電極600の個数は多い方が良く、2次収差を補正するためには最低7個の分割電極、503次収差を補正するためには最低9個の分割電極、4次

収差を補正するためには最低13個の分割電極、5次収差を補正するためには最低16個の分割電極、7次収差を補正するためには最低25個の分割電極が必要となる。なお、2次収差とは、ティルト、非点収差、コマ収差のx方向、y方向の2方向の成分である。ただし、低コストの商品では最低でも3つの分割電極があれば、大きな収差又は大きな振れは補正できる。

【0116】最後に、本発明で用いる用語の定義を述べておく。

【0117】光学装置とは、光学系あるいは光学素子を 10 含む装置のことである。光学装置単体で機能しなくてもよい。つまり、装置の一部でもよい。

【0118】光学装置には、撮像装置、観察装置、表示装置、照明装置、信号処理装置等が含まれる。

【0119】撮像装置の例としては、フィルムカメラ、デジタルカメラ、ロボットの眼、レンズ交換式デジタルー眼レフカメラ、テレビカメラ、動画記録装置、電子動画記録装置、カムコーダ、VTRカメラ、電子内視鏡等がある。デジカメ、カード型デジカメ、テレビカメラ、VTRカメラ、動画記録カメラなどはいずれも電子撮像 20 装置の一例である。

【0120】観察装置の例としては、顕微鏡、望遠鏡、 眼鏡、双眼鏡、ルーペ、ファイバースコープ、ファイン ダー、ビューファインダー等がある。

【0121】表示装置の例としては、液晶ディスプレイ、ビューファインダー、ゲームマシン(ソニー社製プレイステーション)、ビデオプロジェクター、液晶プロジェクター、頭部装着型画像表示装置(head mounted display: HMD)、PDA(携帯情報端末)、携帯電話等がある。

【0122】照明装置の例としては、カメラのストロボ、自動車のヘッドライト、内視鏡光源、顕微鏡光源等がある。

【0123】信号処理装置の例としては、携帯電話、パソコン、ゲームマシン、光ディスクの読取・書込装置、 光計算機の演算装置等がある。

【0124】撮像素子は、例えばCCD、撮像管、固体 撮像素子、写真フィルム等を指す。また、平行平面板は プリズムの1つに含まれるものとする。観察者の変化に は、視度の変化を含むものとする。被写体の変化には、 被写体となる物体距離の変化、物体の移動、物体の動 き、振動、物体のぶれ等を含むものとする。

【0125】拡張曲面の定義は以下の通りである。球面、平面、回転対称非球面のほか、光軸に対して偏心した球面、平面、回転対称非球面、あるいは対称面を有する非球面、対称面を1つだけ有する非球面、対称面のない非球面、自由曲面、微分不可能な点、線を有する面等、いかなる形をしていても良い。反射面でも、屈折面でも、光になんらかの影響を与えうる面ならば良い。本発明では、これらを総称して拡張曲面と呼ぶことにす

る。

(15)

40

【0126】光学特性可変光学素子とは、可変焦点レンズ、可変形状鏡、面形状の変わる偏光プリズム、頂角可変プリズム、光偏向作用の変わる可変回折光学素子、つまり可変HOE,可変DOE等を含む。

【0127】可変焦点レンズには、焦点距離が変化せず、収差量が変化するような可変レンズも含むものとする。可変形状鏡についても同様である。要するに、光学素子で、光の反射、屈折、回折等の光偏向作用が変化しうるものを光学特性可変光学素子と呼ぶ。

【0128】情報発信装置とは、携帯電話、固定式の電話、ゲームマシン、テレビ、ラジカセ、ステレオ等のリモコンや、パソコン、パソコンのキーボード、マウス、タッチパネル等の何らかの情報を入力し、送信することができる装置を指す。 撮像装置のついたテレビモニター、パソコンのモニター、ディスプレイも含むものとする。情報発信装置は、信号処理装置の中に含まれる。

【0129】以上説明したように、本発明の可変形状鏡を用いたカメラは、特許請求の範囲に記載された発明の他に、次に示すような特徴も備えている。

【0130】(1)撮影レンズを通して結像された画像から画像信号を得る撮像手段と、撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動制御を含む制御を行う露光制御手段と、静電引力により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡と、前記可変形状鏡を駆動するを供給する電源供給手段と、前記可変形状鏡を駆動する駆動手段と、前記撮影レンズを駆動する手段と、を有し、前記撮影レンズが駆動されているか、または前記露光制御手段による商記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする可変形状鏡を用いたカメラ。

【0131】(2)撮影レンズを通して結像された画像から画像信号を得る撮像手段と、撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動制御を含む制御を行う露光制御手段と、電磁気力により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡と駆動するための電源を供給する電源供給手段と、前記可変形状鏡を駆動する駆動手段と、前記撮影レンズを駆動する手段と、を有し、前記撮影レンズが駆動されているか、または前記露光制御手段による露光制御が行われているときには、前記駆動手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする可変形状鏡を用いたカメラ。

【0132】(3)撮影レンズを通して結像された画像から画像信号を得る撮像手段と、撮影条件に基づいた露光動作により前記撮像手段の駆動制御を含む制御を行う露光制御手段と、圧電効果により変形する反射面と、該反射面の形状を制御する電極とを有してなる可変形状鏡を駆動するための電源を供給する電

源供給手段と、前記可変形状鏡を駆動する駆助手段と、前記撮影レンズを駆動する手段と、を有し、前記撮影レンズが駆動されているか、または前記露光制御手段による露光制御が行われているときには、前記駆助手段による前記可変形状鏡の駆動を行わないようにしたことを特徴とする可変形状鏡を用いたカメラ。

【0133】(4)前記可変形状鏡を、被写体の距離を 測定する測距部の測距用の光を投光する光路中に設けた ことを特徴とする請求項1~4、上記(1)~(3)の いずれかに記載の可変形状鏡を用いたカメラ。

【0134】(5)前記可変形状鏡を、撮影レンズとともに構成された撮影レンズ系に設けたことを特徴とする 請求項1~4、上記(1)~(3)のいずれかに記載の 可変形状鏡を用いたカメラ。

【0135】(6)被写体の距離を測定する測距部による測距処理中においても、前記電源供給手段による電源供給または前記駆動手段による駆動を行わないようになされたことを特徴とする上記(5)に記載の可変形状鏡を用いたカメラ。

[0136]

【発明の効果】本発明によれば、レンズ駆動中及び露光動作中に、可変形状鏡の駆動を行わないため、電源系へ負担がかからない。また、ストロボ充電中に、可変形状鏡の駆動を行わないため、ストロボ使用するときでも電源系へ負担がかからない。さらに、撮像データ記録中に、可変形状鏡の駆動を行わないため、データ記録動作に悪影響を与えることがない。さらにまた、撮影モード以外の処理において、可変形状鏡の駆動を行わないため、その分省電動作をすることができる。従って、本発明によれば、可変形状鏡をカメラに適用した場合でも電 30源系への負担を軽減させて動作を安定化させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる可変形状鏡を用いたカメラのシステム概略構成図である。

【図2】本実施形態のカメラに用いる可変形状鏡を構成する電極の配置関係及び電圧制御を行なう電源回路部のブロック図である。

【図3】本実施形態のカメラに用いる可変形状鏡の複数 に分割された電極を駆動するときのタイミングチャート である。

【図4】本実施形態のカメラに用いる可変形状鏡の電極部を示す説明図であり、(a)~(e)は、図2に示す上部電極201の変形状態を示す側面図、(f)及び(g)は図2に示す下部電極202の配置構成を示す平面図である。

【図5】本実施形態のカメラにおいて、可変形状鏡を測 距部に用いた例を示す説明図である。

【図6】本実施形態の可変形状鏡を用いたカメラにおける撮影時の駆動制御を示すフローチャートである。

【図7】本実施形態の可変形状鏡を用いたカメラにおけ 50 を可変にする場合の一例の構成を示す図である。

る測距処理のフローチャートである。

(16)

【図8】本実施形態のカメラにおいて、可変形状鏡を撮像部に用いた一例を示す概略構成図である。

【図9】本実施形態のカメラにおいて、可変形状鏡を撮像部に用いた他の例を示す概略構成図である。

【図10】本発明のカメラの他の実施例にかかる、光学 特性ミラーを用いたデジタルカメラのケブラー式ファイ ンダーの概略構成図である。

【図11】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡40 10 9の他の実施例を示す概略構成図である。

【図12】図11の実施例の可変形状鏡に用いる電極の 一形態を示す説明図である。

【図13】図11の実施例の可変形状鏡に用いる電極の 他の形態を示す説明図である。

【図14】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡40 9のさらに他の実施例を示す概略構成図である。

【図15】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡40 9のさらに他の実施例を示す概略構成図である。

【図16】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡40 20 9のさらに他の実施例を示す概略構成図である。

【図17】図16の実施例における薄膜コイル427の 巻密度の状態を示す説明図である。

【図18】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡40 9のさらに他の実施例を示す概略構成図である。

【図19】図18の実施例におけるコイル427の一配置例を示す説明図である。

【図20】図18の実施例におけるコイル427の他の配置例を示す説明図である。

【図21】図16に示した実施例において、コイル427の配置を図20に示したようにした場合に適する永久磁石426の配置を示す説明図である。

【図22】本発明のさらに他の実施例に係る、カメラに 適用可能な可変形状鏡409を用いた撮像系、例えば携帯電話のデジタルカメラ、カプセル内視鏡、電子内視鏡、パソコン用デジタルカメラ、PDA用デジタルカメラ等に用いられる撮像系の概略構成図である。

【図23】本発明のカメラに適用可能な可変形状鏡のさらに他の実施例に係る、マイクロポンプ180で流体161を出し入れし、レンズ面を変形させる可変形状鏡188の概略構成図である。

【図24】本発明のカメラに適用可能なマイクロボンプ の一実施例を示す概略構成図である。

【図25】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ の原理的構成を示す図である。

【図26】一軸性のネマティック液晶分子の屈折率楕円 体を示す図である。

【図27】図25に示す高分子分散液晶層に電界を印加 状態を示す図である。

【図28】図25に示す高分子分散液晶層への印加電圧 を可変にする場合の一例の構成を示す図である 10

45, 55

50 52

【図29】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ を用いるデジタルカメラ用の撮像光学系の一例の構成を 示す図である。

【図30】本発明のカメラに適用可能な可変焦点回折光 学素子の一例の構成を示す図である。

【図31】ツイストネマティック液晶を用いる可変焦点 レンズを有する可変焦点眼鏡の構成を示す図である。

【図32】図31に示すツイストネマティック液晶層への印加電圧を高くしたときの液晶分子の配向状態を示す図である。

【図33】本発明のカメラに適用可能な可変偏角プリズムの二つの例の構成を示す図である。

【図34】図33に示す可変偏角プリズムの使用態様を 説明するための図である。

【図35】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ としての可変焦点ミラーの一例の構成を示す図である。

【図36】本発明のカメラに適用可能なさらに他の実施例に係る、可変焦点レンズ140を用いた撮像ユニット141の概略構成図である。

【図37】図36の実施例における可変焦点レンズの変 20 形例を示す説明図である。

【図38】図35の可変焦点レンズが変形した状態を示す説明図である。

【図39】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズのさらに他の実施例に係る、マイクロポンプ160で流体161を出し入れし、レンズ面を変形させる可変焦点レンズ162の概略構成図である。

【図40】本発明のカメラに適用可能な光学特性可変光 学素子の他の実施例であって圧電材料200を用いた可 変焦点レンズ201の概略構成図である。

【図41】図40の変形例に係る可変焦点レンズの状態 説明図である。

【図42】本発明のカメラに適用可能な光学特性可変光学素子のさらに他の実施例であって圧電材料からなる2枚の薄板200A,200Bを用いた可変焦点レンズの概略構成図である。

【図43】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ のさらに他の実施例を示す概略構成図である。

【図44】図43の実施例に係る可変焦点レンズの状態 説明図である。

【図45】本発明のカメラに適用可能な光学特性可変光 学素子のさらに他の実施例であってフォトニカル効果を 用いた可変焦点レンズの概略構成図である。

【図46】図45の実施例に係る可変焦点レンズに用いるアゾベンゼンの構造を示す説明図であり、(a)はトランス型、(b)はシス型を示している。

【図47】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ に用いる透明電極の一分割例を示す説明図である。

【図48】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ に用いる透明電極の他の分割例を示す説明図である。 【図49】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ に用いる選明電極のさらに他の分割例を示す説明図である。

【図50】本発明のカメラに適用可能な可変焦点レンズ に用いる透明電極のさらに他の分割例を示す説明図であ

ခ.	
【符号の説明	月】
1.:	撮像レンズ系
2	レンズ駆動部
3	损 像素子
4	撮像回路
5	測光回路
6	A/D変換器
7	バッファメモリ
8	ストロボ発光回路
9	モ ∽ドLCD
1 0	操作スイッチ
11, 42,	188 可変形状鏡
1.2	可変形状鏡の駆動電源部(電源回路)
1 3	システムコントローラ
1 4	EEPROM
1 5	データ圧縮/伸張回路
1 6	1/F
1 7	外部1/F
18 .	ビデオメモリ
19	RISC型マイクロチップ
2 0	DSP(デジタル・シグナル・プロセッ
サ)	
2 1	上部電極
2 2	下部電極
23	反射面
2 4	電圧制御回路部
25	電圧制御トランジスタ
26	制御回路
2 7	タイミング発生回路
2 8	スイッチング用トランジスタ
3 1	赤外発光ダイオード
3 2	反射鏡
3 3	投光レンズ
3 4	投光用窓
3 5	受光窓
3 6	受光レンズ
3 7	受光器
	102, 512a, 512b, 522, 5
37, 538	•
43,53	
44.54	赤外カットフィルター

ローパスフィルター

傾き可変な可変形状鏡

固体摄像索子

46, 408, 523, 529

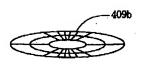
(--

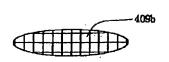
33		- 34
59, 145, 513a, 513b, 600	k	* 4 1 3 電源スイッチ
透明電極		414 演算装置
103 制御系		415 温度センサー
103' 回路		416 湿度センサー
104, 141 撮像ユニット		417 距離センサー
140, 162, 201, 207, 214, 511, 5		423 支持台
27可変焦点レンズ		424 振れセンサー
142 透明部材		425, 428 駆動回路
143 圧電性のある透明物質		426 永久磁石
	10	427 コイル
146 シリンダー		508a, 532a, 562a, 566a 第
147 支援部材		1の面
148 変形可能な部材		508b, 532b, 562b, 566b 第
160, 180 マイクロボンプ		2の面
161 流体		509a, 533a, 563a, 567a 第
163, 165, 204, 532, 533, 562, 5		3の面
63,566,567透明基板		509b, 533b, 563b, 567b 第
164 弾性体		4の面
168 液溜		514 高分子分散液晶層
181 振動板	20	515 スイッチ
182, 183, 409b, 409d 電極		5 1 6 交流電源
184, 185 弁		517 液晶分子
189 反射膜		518 高分子セル
200 圧電材料		519 可変抵抗器
200A, 200B 薄板		521,526 絞り
202 透明で柔らかい基板		525 前方レンズ
206,409c-2. 電歪材料		528 後方レンズ
208,209 透明弾性体		531 可変焦点回折光学素子
210 アゾベンゼン		535 可変焦点眼鏡
211 スペーサー	30	535a フレーム
212,213 紫外光源		536 可変焦点回折光学素子
403 撮像レンズ		539a, 539b 配向膜
404 プリズム		545 物体
405 二等辺直角プリズム		546 測距センサ
406 ミラー		561 可変偏角プリズム
409 光学特性可変形状鏡	•	565 可変焦点ミラー
409a 薄膜		568 反射膜
409c, 409c' 圧電素子		600A, 600B, 600C 分割された一
409c-1, 409e 基板		つ一つの電極
411 可変抵抗器	40	901 接眼レンズ
4 1 2 電源 **	:	902 対物レンズ

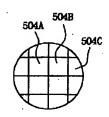
【図12】

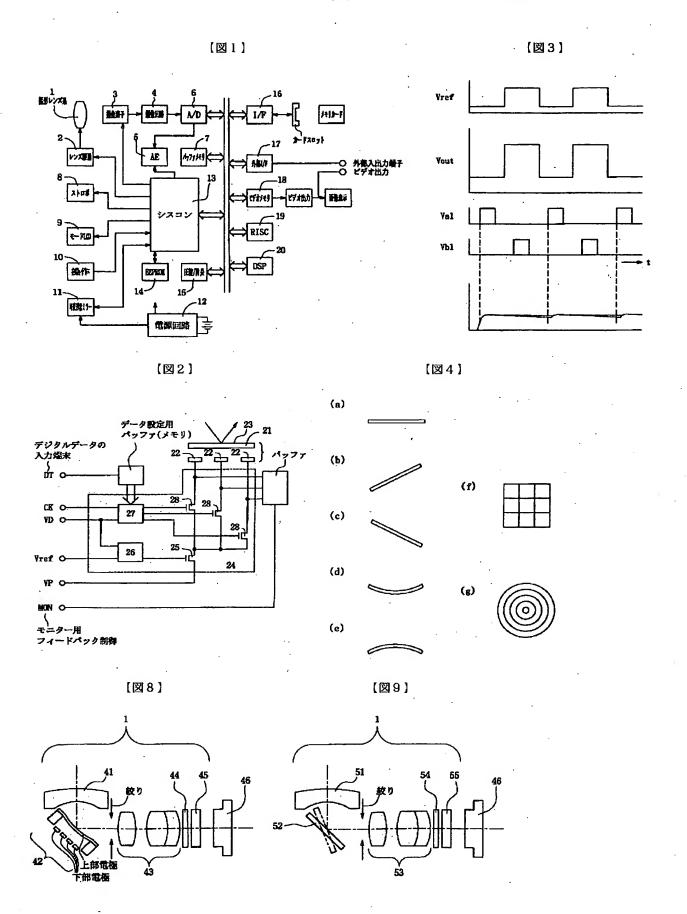
【図13】

【図50】

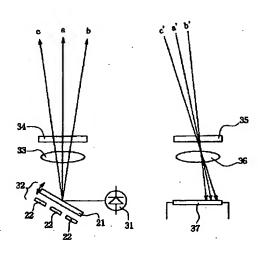




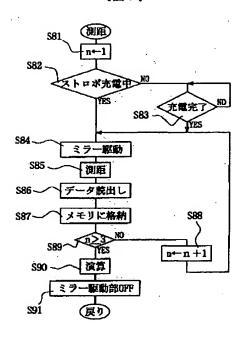




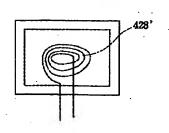
【図5】



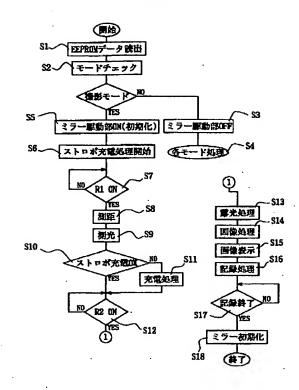
【図7】



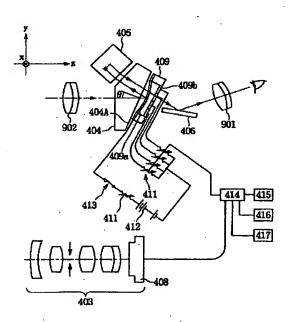
[図17]



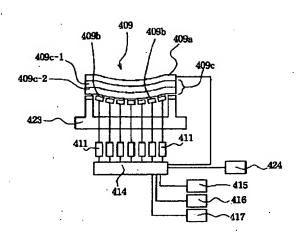
【図6】



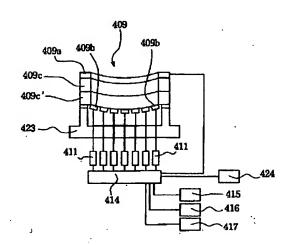
【図10】



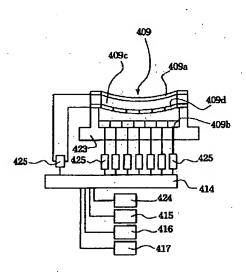
【図11】



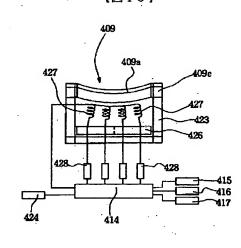
[図14]



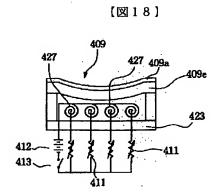
[図15]

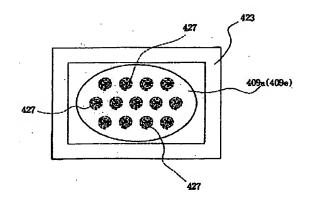


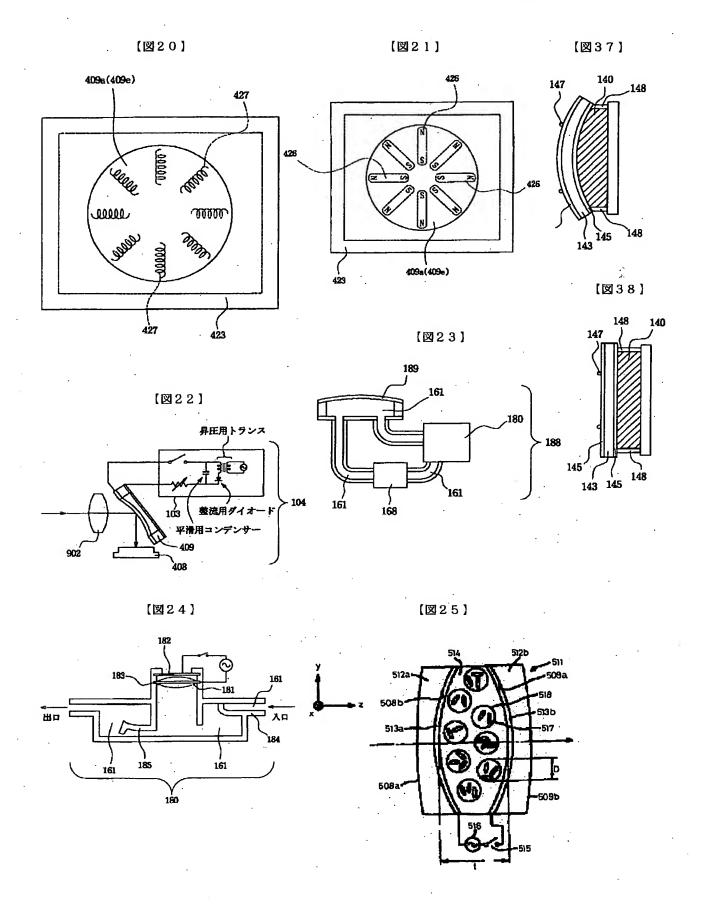
【図16】



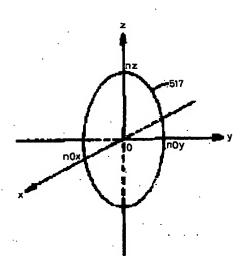
[図19]



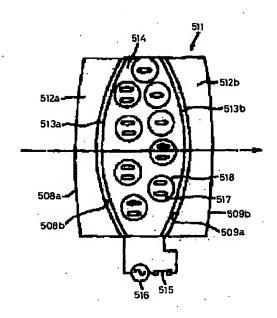




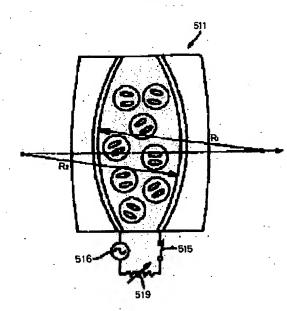
[図26]



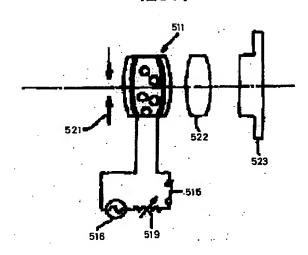
【図27】



【図28】

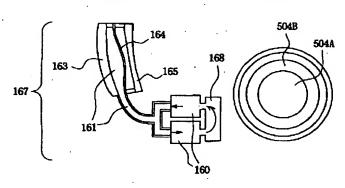


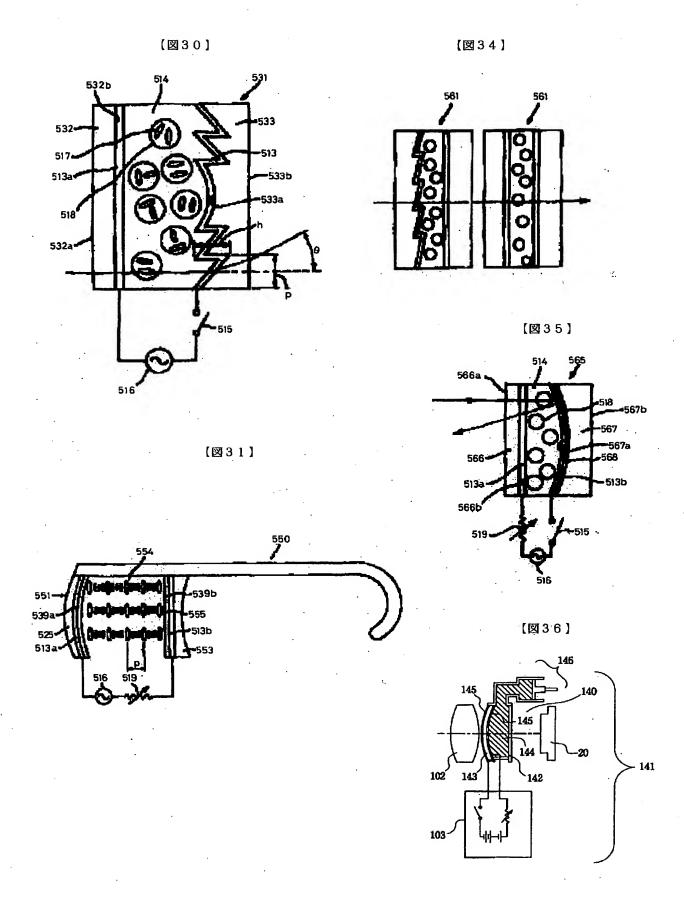
【図29】



[図39]

【図47】



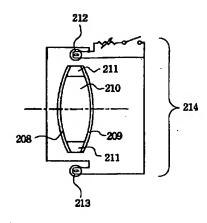


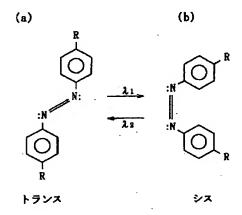
[図32] 【図40】 202 161 【図42】 [図33] 【図41】 (a) 200A 200B 562a 161 (b) [図43] 【図44】 516 206

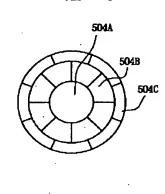
[図45]

【図46】

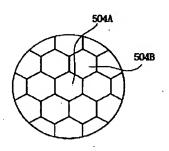
【図48】







【図49】



フロントページの続き

(51)Int.C1.' H 0 4 N 5/225 識別記号

FI HO4N 5/225 テーマコード (参考)

D

Fターム(参考) 2H041 AA11 AB14 AC02 AC06 AC07 AC08 AZ01 AZ05 AZ08

2H042 DB08 DD04 DD13 DE09

2H100 CC00 DD15 FF01

2H101 DD16 DD21 DD23 DD24 FF00

5C022 AB15 AB27 AB40 AB67 AC42

AC51 AC54 AC55